

微小電流測定用セミオートプローバ

- ・ガード電位技術を活用した構造により、fAレベルの微小電流測定が可能。
- ・ガード構造の徹底で、低雑音・高精度測定を実現。
- ・外部自動制御とジョイスティック(移動モード6種類)の手動操作が可能。
- ・主要な測定器メーカーのシステムおよびソフトウェアに標準対応。
- ・パワーデバイスにも対応。
- ・サーモチャック(-50°C~+200°C ドライエアパージによる結露防止機構あり)
またはホットチャック(+40°C~+200°C)を用いた温度依存特性評価が可能。
- ・使用目的に合わせたカスタマイズが可能。

AP-80A 仕様

最大ウェーハサイズ	φ200mm
ステージ移動範囲	X:210mm Y:250mm
ステージ可動最小分解能	1μm
ステージ位置決め精度	±10μm
ステージ繰り返し位置決め精度	±2μm
Z軸 ステージストローク	9mm + 0.5mm (オーバードライブ)
θ軸 ステージ回転角度	±5°
制御インターフェース	GP-IB
外形寸法(W×D×H)	820 × 930 × 1,220mm (オプション含まず)
装置重量	500kg (オプション含まず)

AP-80A Options

- ・マイクロコンピュータ
- ・同軸プローブ・精密プローブ針
- ・同軸ケーブル
- ・変換コネクタ
- ・プローブカード
- ・温度コントローラ・サーモチャック・ホットチャック
- ・顕微鏡・CCDカメラ
- ・プローバコントロールソフト



Semi-automatic prober for low current measurement

- The fully-guarded structure allows accurate low current measurement down to fA-level.
- Fully guarded structures provide low noise and high accuracy measurement.
- Both external automatic control and manual joy stick operation (six movement modes) are possible.
- Standard model for systems and software of major measuring instrument manufacturers.
- Manipulator and wafer chuck options enable power device measurement and characterization.
- Can be equipped with thermal chuck (-50°C to +200°C dew condensation prevention mechanism with dry air purge) or hot chuck (+40°C to +200°C) for evaluation of temperature-dependent properties.
- Customizable according to intended use.

AP-80A Specifications

Maximum wafer size	φ 200 mm
Stage travel	X : 210 mm Y : 250 mm
Travel resolution	1 μm
Accuracy in the positioning stage	±10 μm
Repeat accuracy in the positioning stage	±2 μm
Z stroke	9 mm + 0.5 mm (overdrive)
θ travel	±5°
Control interface	GP-IB
External dimensions (WxDxH)	820 × 930 × 1,220 mm (excluding options)
Weight	500 kg (excluding options)

AP-80A Options

- Micro manipulators
- Coaxial probes and precision probe needles
- Coaxial cables
- Conversion connectors
- Probe cards
- Temperature controllers, thermal chucks and hot chucks
- Microscopes and CCD camera
- Prober control software

